

Title (en)

Device and method for processing objects of different dimensions

Title (de)

Vorrichtung und Verfahren zum Verarbeiten von Gegenständen unterschiedlicher Abmessungen

Title (fr)

Dispositif et procédé de traitement d'objets ayant différentes dimensions

Publication

EP 2316580 A1 20110504 (DE)

Application

EP 10189761 A 20101103

Priority

DE 102009046324 A 20091103

Abstract (en)

The arrangement has a conveyor, a separation device (VV), a format-separation device and a processing device. The processing device is formed for a format class for processing of flat objects. The arrangement is designed to transport flat objects, which are dumped on the conveyor, along a conveyor path to the separation device and from the separation device to the format-separation device. The separation device is arranged in the conveyor path and upstream the format-separation device. An independent claim is also included for a method for processing of flat objects.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Aufstellen und Verarbeiten von Gegenständen unterschiedlicher Abmessungen, insbesondere von flachen Postsendungen. Eine Fördereinrichtung transportiert Gegenstände zu einer Aufrichtvorrichtung. Die Aufrichtvorrichtung transportiert die Gegenstände weiter und richtet sie dabei so auf, dass die aufgerichteten Gegenstände auf einer Kante stehen. Aufgerichtete Gegenstände werden zu einer Vereinzelungsvorrichtung (VV) transportiert. Die Vereinzelungsvorrichtung (VV) vereinzelt flache Gegenstände, so dass ein Strom aufrecht stehender, zueinander beabstandeter Gegenstände die Vereinzelungsvorrichtung (VV) verlässt. Aufgerichtete und vereinzelte Gegenstände werden zu einer Format-Trenneinrichtung (FM, Verzw) transportiert. Die Format-Trenneinrichtung (FM, Verzw) teilt die Gegenstände abhängig von ihren Abmessungen dergestalt in Gegenstands-Klassen auf, dass alle Gegenstände einer Gegenstandsmenge zu derselben Formatklasse gehören. Alle Gegenstände einer Gegenstands-Menge werden als Strom von aufrecht stehenden und beabstandeten Gegenständen zu einer passenden Verarbeitungseinrichtung (VE-S, VE-G) transportiert. Diese Verarbeitungseinrichtung verarbeitet die Gegenstände.

IPC 8 full level

B07C 1/10 (2006.01); **B65H 5/26** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B07C 1/10 (2013.01 - EP US); **B65H 5/26** (2013.01 - EP US); **B65H 5/38** (2013.01 - EP US); **B65H 2301/321** (2013.01 - EP US); **B65H 2301/4473** (2013.01 - EP US); **B65H 2404/267** (2013.01 - EP US); **B65H 2404/692** (2013.01 - EP US); **B65H 2511/10** (2013.01 - EP US); **B65H 2513/42** (2013.01 - EP US); **B65H 2701/1916** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)

- US 5505440 A 19960409 - UEMATSU MASAKI [JP]
- DE 1054015 B 19590326 - STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG
- DE 19612525 A1 19971002 - AEG ELECTROCOM GMBH [DE]
- US 6715755 B2 20040406 - SUSSMEIER JOHN W [US]
- US 6186312 B1 20010213 - SCHERERZ HOLGER [DE]
- DE 10148226 C1 20030424 - SIEMENS DEMATIC AG [DE]
- DE 10038690 C1 20010726 - SIEMENS AG [DE]
- DE 1774625 A1 19711014 - TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO
- DE 19612525 C2 20000302 - SIEMENS AG [DE]
- DE 102004037420 B3 20051215 - SIEMENS AG [DE]
- DE 4315053 C2 19950216 - LICENTIA GMBH [DE]
- DE 4345160 C2 19950330 - LICENTIA GMBH [DE]

Citation (search report)

[AD] US 5505440 A 19960409 - UEMATSU MASAKI [JP]

Cited by

DE102012016659A1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2316580 A1 20110504; **EP 2316580 B1 20130717**; CA 2719509 A1 20110503; ES 2431370 T3 20131126; US 2011100881 A1 20110505; US 8261917 B2 20120911

DOCDB simple family (application)

EP 10189761 A 20101103; CA 2719509 A 20101101; ES 10189761 T 20101103; US 93887110 A 20101103